

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2015-175762
(P2015-175762A)

(43) 公開日 平成27年10月5日(2015.10.5)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 D 5/244 (2006.01)	GO 1 D 5/244 J	2 F 0 7 7
GO 1 D 5/245 (2006.01)	GO 1 D 5/245 1 1 0 M	5 H 5 6 0
HO 2 P 6/16 (2006.01)	HO 2 P 6/00 3 3 1 H	

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号	特願2014-53242 (P2014-53242)	(71) 出願人	000002369
(22) 出願日	平成26年3月17日 (2014. 3. 17)		セイコーエプソン株式会社
			東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(74) 代理人	110000028
			特許業務法人明成国際特許事務所
		(74) 代理人	100096817
			弁理士 五十嵐 孝雄
		(72) 発明者	竹内 啓佐敏
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72) 発明者	西澤 克彦
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

最終頁に続く

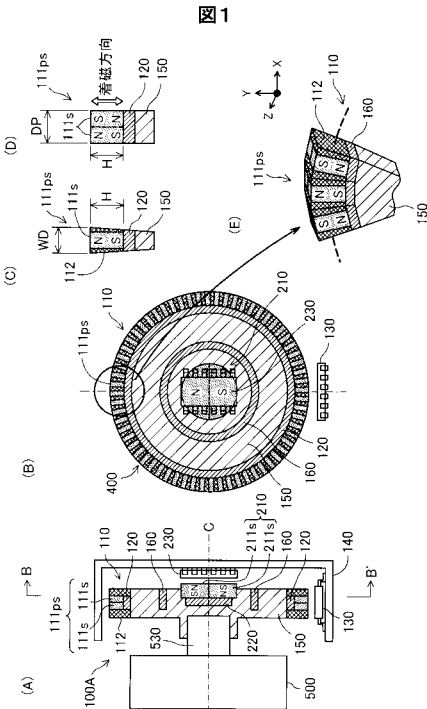
(54) 【発明の名称】 エンコーダー、電気機械装置、ロボット、及び、鉄道車両

(57) 【要約】

【課題】エンコーダーを用いて高精度に位置検出を行う。

【解決手段】エンコーダーは、M1極（M1は4以上の偶数）の第1磁石体と、M2極（M2は2以上の偶数）の第2磁石体と、第1の2軸磁気センサー回路と、第2の2軸磁気センサー回路と、位置信号生成部とを備える。各磁石体を構成する個々の小磁石は、2軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されている。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 部材に対して所定の移動方向に沿って移動する第 2 部材の位置を測定するエンコーダーであって、

前記第 2 部材に設けられた複数の第 1 小磁石を含む M 1 極 (M 1 は 4 以上の偶数) の第 1 磁石体と、

前記第 2 部材に設けられた複数の第 2 小磁石を含む M 2 極 (M 2 は 2 以上の偶数) の第 2 磁石体と、

前記第 1 磁石体の表面から一定のギャップを有して前記第 1 部材上に配置された第 1 の 2 軸磁気センサー回路と、

前記第 2 磁石体の表面から一定のギャップを有して前記第 1 部材上に配置された第 2 の 2 軸磁気センサー回路と、

前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の出力信号を処理する位置信号生成部と、

を備え、

前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路は、それぞれ 2 つの感磁軸方向を有し、

前記第 1 磁石体を構成する個々の第 1 小磁石は、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されており、

前記第 2 磁石体を構成する個々の第 2 小磁石は、前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されており、

前記位置信号生成部は、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の第 1 磁気角出力と、前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の第 2 磁気角出力とに応じて、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の位置を示す位置信号を生成する、エンコーダー。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のエンコーダーであって、

前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路のそれぞれは、互いに直交する X 軸と Y 軸のうちの前記 X 軸に沿った磁場を測定するための複数の X 軸センサー素子と、前記 Y 軸に沿った磁場を測定するための複数の Y 軸センサー素子と、を含む、エンコーダー。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載のエンコーダーであって、

前記整数 M 1 , M 2 は、M 1 / 2 と M 2 / 2 が互いに素となる整数であり、

前記位置信号生成部は、前記第 1 の 2 軸磁気センサーの第 1 磁気角出力と前記第 2 の 2 軸磁気センサーの第 2 磁気角出力から前記位置信号を生成する、エンコーダー。

【請求項 4】

請求項 3 に記載のエンコーダーであって、

前記整数 M 1 は、 2^{Q+1} (Q は 1 以上の整数) に等しく、

前記整数 M 2 は、2 に等しく、

前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の第 1 磁気角出力は、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の相対位置を示す N 1 ビット (N 1 は 2 以上の整数) のデジタル信号であり、

前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の第 2 磁気角出力は、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の相対位置を示す N 2 ビット (N 2 は 2 以上の整数) のデジタル信号であり、

前記位置信号生成部は、前記第 2 磁気角出力の最上位 Q ビットを最上位に配置するとともに、前記第 1 磁気角出力の N 1 ビットを前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットの下に配置した (N 1 + Q) ビットの信号を前記位置信号として生成する、エンコーダー。

【請求項 5】

請求項 4 に記載のエンコーダーであって、

前記位置信号生成部は、

前記第 2 の部材の移動に応じて前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の前記第 1 磁気角出力

と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の前記第 2 磁気角出力とがともに増加する際に、前記第 1 磁気角出力が前記第 1 磁気角出力の最大値から最小値に戻るタイミングと、前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットがインクリメントするタイミングとが一致するように、前記第 1 磁気角出力に応じて前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットを補正し、

前記補正後の前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットを用いて、前記 (N 1 + Q) ビットのの前記位置信号を生成する、
エンコーダー。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載のエンコーダーであって、

前記第 2 部材は、回転体であり、

前記第 1 磁石体は、互いに逆方向に磁化された 2 つの第 1 小磁石によって構成された小磁石ペアを複数組み、

前記複数組の小磁石ペアは、前記回転体の回転軸廻りの円形の軌道に沿って配置されている、エンコーダー。

【請求項 7】

請求項 6 に記載のエンコーダーであって、

個々の第 1 小磁石は、直方体形状を有し、

各小磁石ペアは、2 つの第 1 小磁石と、前記 2 つの第 1 小磁石の周囲の少なくとも一部を被覆することによって前記小磁石ペアの全体の形状を等辺台形柱形状とする被覆部材と、を有する、エンコーダー。

【請求項 8】

請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載のエンコーダーであって、

前記第 1 小磁石と前記第 2 小磁石の少なくとも一方は、強磁性薄膜によって形成されている、エンコーダー。

【請求項 9】

電気機械装置であって、

前記電気機械装置のローターに接続された請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載のエンコーダーと、

前記電気機械装置の動作を制御する制御部と、
を備える、電気機械装置。

【請求項 10】

請求項 9 に記載の電気機械装置であって、

前記電気機械装置は、2 相の電磁コイルを有する 2 相 AC ブラシレスモーターであり、

前記制御部は、前記エンコーダーの前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路から出力される前記正弦波信号及び前記余弦波信号から、前記 2 相の電磁コイルの駆動信号を生成する駆動信号生成部を有する、電気機械装置。

【請求項 11】

請求項 9 又は 10 に記載の電気機械装置を備えるロボット。

【請求項 12】

請求項 9 又は 10 に記載の電気機械装置を備える鉄道車両。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、磁気センサーを用いたエンコーダー、及び、それを用いた各種の装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

磁気センサーを用いたエンコーダーとしては、特許文献 1 に記載されたロータリーエンコーダーが知られている。ロータリーエンコーダーの回転体には、その中心に第 1 マグネットが設けられ、外周側には環状の複数の第 2 マグネットが設けられている。また、回転

10

20

30

40

50

体に対向する固定体には、第 1 マグネットの磁場を検出する第 1 感磁素子と、第 2 マグネットの磁場を検出する第 2 感磁素子とが設けられている。第 1 感磁素子と第 2 感磁素子のそれぞれは、互いに直交する方向に設けられた 2 つの磁気抵抗パターンで構成されている。磁気抵抗パターンで磁場を適切に検出するために、第 1 マグネット及び第 2 マグネットは、感磁素子に向かう方向（すなわち回転軸に平行な方向）に沿って着磁されており、その着磁面（着磁方向と直交する面）が感磁素子に対向するように配置されている。但し、これらの第 1 感磁素子と第 2 感磁素子では、絶対的な回転角度を検出することができない。そこで、絶対的な回転角度を検出するために、固定体の上に、90 度の角度で配置された 2 つのホール素子が設けられている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2012 - 112707 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、上述した従来のエンコーダーでは、磁気抵抗パターンを用いて磁場を検出しているので、磁気抵抗パターンの抵抗の精度によって回転角度の検出精度が制限される。一般に、磁気抵抗パターンの抵抗の精度を高めることは困難である。そこで、より高精度に回転角度を検出することのできる技術が望まれていた。また、回転角度に限らず、一般に、高精度に位置を検出することのできるエンコーダーが望まれていた。更に、電気機械装置に関しても、エンコーダーを用いて高精度に位置検出を行うことを可能とする技術が望まれていた。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態として実現することが可能である。

【0006】

(1) 本発明の一形態によれば、第 1 部材に対して所定の移動方向に沿って移動する第 2 部材の位置を測定するエンコーダーが提供される。このエンコーダーは、前記第 2 部材に設けられた複数の第 1 小磁石を含む M1 極（M1 は 4 以上の偶数）の第 1 磁石体と；前記第 2 部材に設けられた複数の第 2 小磁石を含む M2 極（M2 は 2 以上の偶数）の第 2 磁石体と；前記第 1 磁石体の表面から一定のギャップを有して前記第 1 部材上に配置された第 1 の 2 軸磁気センサー回路と；前記第 2 磁石体の表面から一定のギャップを有して前記第 1 部材上に配置された第 2 の 2 軸磁気センサー回路と；前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の出力信号を処理する位置信号生成部と、を備える。前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路は、それぞれ 2 つの感磁軸方向を有する。前記第 1 磁石体を構成する個々の第 1 小磁石は、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されており、前記第 2 磁石体を構成する個々の第 2 小磁石は、前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されている。前記位置信号生成部は、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の第 1 磁気角出力と、前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の第 2 磁気角出力とに応じて、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の位置を示す位置信号を生成する。

このエンコーダーによれば、2 軸磁気センサー回路を用いているので、精度良く位置検出を行うことが可能である。また、位置信号生成部は、第 1 の 2 軸磁気センサー回路の第 1 磁気角出力と第 2 の 2 軸磁気センサー回路の第 2 磁気角出力とに応じて位置信号を生成するので、1 つの 2 軸磁気センサー回路を用いる場合に比べて更に高精度に位置検出を行うことができる。更に、各磁石体を構成する個々の小磁石は、2 軸磁気センサー回路の感磁面に交差する方向に磁化されているので、2 軸磁気センサー回路によって小磁石の強い磁場を検出することができ、この結果、高精度な位置検出が可能である。

【 0 0 0 7 】

(2) 上記エンコーダーにおいて、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路のそれぞれは、互いに直交する X 軸と Y 軸のうちの前記 X 軸に沿った磁場を測定するための複数個の X 軸センサー素子と、前記 Y 軸に沿った磁場を測定するための複数個の Y 軸センサー素子と、を含むものとしてもよい。

この構成によれば、2 軸磁気センサー回路の複数のホール素子の出力として、磁気歪みの少ない正弦波状の出力を得ることができ、これらの磁気歪みの少ない正弦波状出力に基づいて精度良く位置検出を行うことが可能である。

【 0 0 0 8 】

(3) 上記エンコーダーにおいて、前記整数 M_1 、 M_2 は、 $M_1 / 2$ と $M_2 / 2$ が互いに素となる整数であり、前記位置信号生成部は、前記第 1 の 2 軸磁気センサーの第 1 磁気角出力と前記第 2 の 2 軸磁気センサーの第 2 磁気角出力から前記位置信号を生成するものとしてもよい。

10

この構成によれば、第 1 の 2 軸磁気センサーの第 1 磁気角出力と第 2 の 2 軸磁気センサーの第 2 磁気角出力から、第 1 部材に対する第 2 部材の位置を高精度に検出可能である。

【 0 0 0 9 】

(4) 上記エンコーダーにおいて、前記整数 M_1 は、 2^{Q+1} (Q は 1 以上の整数) に等しく、前記整数 M_2 は、2 に等しく、前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の第 1 磁気角出力は、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の相対位置を示す N_1 ビット (N_1 は 2 以上の整数) のデジタル信号であり、前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の第 2 磁気角出力は、前記第 1 部材に対する前記第 2 部材の相対位置を示す N_2 ビット (N_2 は 2 以上の整数) のデジタル信号であり、前記位置信号生成部は、前記第 2 磁気角出力の最上位 Q ビットを最上位に配置するとともに、前記第 1 磁気角出力の N_1 ビットを前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットの下に配置した ($N_1 + Q$) ビットの信号を前記位置信号として生成するものとしてもよい。

20

この構成によれば、第 2 磁気角出力の最上位 Q ビットと、第 1 磁気角出力の N_1 ビットとを組み合わせることによって位置信号のビット数を増加できるので、高精度 (高分解能) の位置検出が可能である。

【 0 0 1 0 】

(5) 上記エンコーダーにおいて、前記位置信号生成部は、前記第 2 の部材の移動に応じて前記第 1 の 2 軸磁気センサー回路の前記第 1 磁気角出力と前記第 2 の 2 軸磁気センサー回路の前記第 2 磁気角出力とがともに増加する際に、前記第 1 磁気角出力が前記第 1 磁気角出力の最大値から最小値に戻るタイミングと、前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットがインクリメントするタイミングとが一致するように、前記第 1 磁気角出力に応じて前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットを補正し、前記補正後の前記第 2 磁気角出力の前記最上位 Q ビットを用いて、前記 ($N_1 + Q$) ビットの前記位置信号を生成するものとしてもよい。

30

この構成によれば、第 2 磁気角出力に無視できない程度の誤差が存在する場合にも、第 2 磁気角出力の最上位 Q ビットと第 1 磁気角出力の N_1 ビットとを組み合わせることによって、正しい位置信号を得ることが可能である。

40

【 0 0 1 1 】

(6) 上記エンコーダーにおいて、前記第 2 部材は、回転体であり、前記第 1 磁石体は、互いに逆方向に磁化された 2 つの第 1 小磁石によって構成された小磁石ペアを複数組み、前記複数組の小磁石ペアは、前記回転体の回転軸廻りの円形の軌道に沿って配置されているものとしてもよい。

この構成によれば、エンコーダーの位置検出精度をより高めることができる。

【 0 0 1 2 】

(7) 上記エンコーダーにおいて、個々の第 1 小磁石は、直方体形状を有し、各小磁石ペアは、2 つの第 1 小磁石と、前記 2 つの第 1 小磁石の周囲の少なくとも一部を被覆することによって前記小磁石ペアの全体の形状を等辺台形柱形状とする被覆部材と、を有するも

50

のとしても良い。

この構成によれば、複数の小磁石ペアを用いた位置検出精度の高いエンコーダーを容易に作成することが可能である。

【0013】

(8) 上記エンコーダーにおいて、前記第1小磁石と前記第2小磁石の少なくとも一方は、強磁性薄膜によって形成されているものとしてもよい。

この構成によれば、小型で強力な小磁石を利用できるので、位置検出精度を高めつつ、エンコーダー全体をコンパクトにすることができる。

【0014】

(9) 本発明の他の形態によれば、電気機械装置が提供される。この電気機械装置は、前記電気機械装置のローターに接続されたエンコーダーと、前記電気機械装置の動作を制御する制御部と、を備える。

この電気機械装置によれば、高精度に電気機械装置のローターの位置検出を行うことが可能である。

【0015】

(10) 上記電気機械装置は、2相の電磁コイルを有するACブラシレスモーターであり、前記制御部は、前記エンコーダーの前記第1の2軸磁気センサー回路から出力される前記正弦波信号及び前記余弦波信号から、前記2相の電磁コイルの駆動信号を生成する駆動信号生成部を有する、ものとしてもよい。

この構成によれば、1つの2軸磁気センサー回路から出力される正弦波信号及び前記余弦波信号から2相の駆動信号を生成するので、磁気センサーの位置ズレなどに起因する駆動信号の位相ズレを防止することが可能である。

【0016】

本発明は、装置以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、エンコーダー、ロータリーエンコーダー、位置検出方法、回転位置検出方法、エンコーダーを備えた電気機械装置、ロボット、鉄道車両、それらの方法又は装置の機能を実現するためのコンピュータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した一時的でない記録媒体(non-transitory storage medium)等の形態で実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【0017】

【図1】第1実施形態のロータリーエンコーダーの構成と動作を示す説明図。

【図2】2軸磁気センサー回路で得られる各種の検出信号を示すグラフ。

【図3】2軸磁気センサー回路内の複数のホール素子の感磁方向を示す説明図。

【図4】2軸磁気センサー回路の回路構成と動作を示す説明図。

【図5】小磁石に対する2軸磁気センサー回路の配置に応じた2軸磁気センサー回路の出力レベルを示す説明図。

【図6】2つの2軸磁気センサー回路から出力される磁気角出力を示す説明図。

【図7】2つの2軸磁気センサー回路の出力を用いて回転体の絶対位置(絶対角度)を決定する位置信号生成部を示す説明図。

【図8】小周期区間値 $P \times$ の補正対象範囲を示す説明図。

【図9】小周期区間値 $P \times$ の補正のアルゴリズムを示すフローチャート。

【図10】第1の磁石体の極数を変更した場合の絶対位置出力のビット数を示す説明図。

【図11】第2実施形態のロータリーエンコーダーの構成を示す説明図。

【図12】第3実施形態のロータリーエンコーダーの構成を示す説明図。

【図13】第4実施形態のロータリーエンコーダーの構成を示す説明図。

【図14】第5実施形態のロータリーエンコーダーの構成を示す説明図。

【図15】第6実施形態のロータリーエンコーダーの構成を示す説明図。

【図16】実施形態のエンコーダーを備える電動機械装置の電氣的構成を示すブロック図。

【図17】主制御回路の内部構成を示すブロック図。

10

20

30

40

50

【図 18】回転数算出部の内部構成と動作を示す説明図。

【図 19】実施形態の電気機械装置を利用したロボットを示す説明図。

【図 20】実施形態の電気機械装置を利用した鉄道車両を示す説明図。

【発明を実施するための形態】

【0018】

A．第 1 実施形態（ロータリーエンコーダー）

図 1 は、第 1 実施形態としてのロータリーエンコーダー 100 A の構成と動作を示す説明図である。図 1 (A) , (B) に示すように、このエンコーダー 100 A は、環状の第 1 の磁石体 110 と、第 1 の磁石体 110 の内側に配置された第 2 の磁石体 210 とを有する。また、第 1 の磁石体 110 の外周に沿って第 1 の磁石体 110 の表面から一定のギャップを有して設けられた第 1 の 2 軸磁気センサー回路 130 と、第 2 の磁石体 210 の表面から一定のギャップを有して設けられた第 2 の 2 軸磁気センサー回路 230 と、を有する。2 つの磁石体 110 , 210 は、支持部材 150 を含む略円板状の回転体 400 (図 1 (B)) に設けられており、2 つの 2 軸磁気センサー回路 130 , 230 は、基板 140 (図 1 (A)) に設けられている。なお、2 軸磁気センサー回路 130 , 230 は、IC パッケージの形状で描かれている。また、図 1 (B) では、第 2 の 2 軸磁気センサー回路 230 を透かして第 2 の磁石体 210 が見える状態を描いている。基板 140 は回転しない固定体（「第 1 部材」とも呼ぶ）を構成し、回転体 400 は回転軸 C の廻りに回転する回転体（「第 2 部材」とも呼ぶ）を構成している。回転体 400 の支持部材 150 は、慣性モーメントの少ない軽量剛性な非磁性材料で形成することが好ましく、例えば、アルミニウム、マグネシウム、ジュラルミン、樹脂、複合樹脂等で形成することが好ましい。第 1 の磁石体 110 の内周側には、環状の第 1 のヨーク部材 120 が設けられており、第 2 の磁石体 210 の裏側には、円板状の第 2 のヨーク部材 220 が設けられている。更に、2 つの磁石体 110 , 210 の間の位置には、磁気遮蔽部材 160 が設けられている。これらの部材 120 , 220 , 160 は不要な磁束の漏れを低減するためのものであり、軟磁性体で形成することが好ましい。但し、これらの部材 120 , 220 , 160 の一部又は全部を省略することも可能である。このエンコーダー 100 A は、任意の回転体の位置検出に適用可能であり、図 1 (A) の例では、モーター 500 の回転軸 530 に接続されている。

【0019】

第 1 の磁石体 110 は、回転体 400 の外周の全周に亘って設けられた 64 組の小磁石ペア 111 p s で構成された 64 極の磁石体である。1 組の小磁石ペア 111 p s は、第 1 の磁石体 110 の 1 つの磁極を構成している。個々の小磁石ペア 111 p s は、回転体 400 の回転軸 C に平行な方向に沿って並んで配置された 2 つの小磁石 111 s (図 1 (A)) で構成されている。図 1 (C) は、図 1 (B) と同様に正面方向から 1 組の小磁石ペア 111 p s を見たときの断面の一部を拡大して示しており、図 1 (D) は、図 1 (A) と同様に側面方向から 1 組の小磁石ペア 111 p s を見たときの断面の一部を拡大して示している。1 組の小磁石ペア 111 p s は、直方体形状を有する 2 つの小磁石 111 s と、被覆部材 112 とで構成されており、全体として等辺台形柱形状を有する。すなわち、正面視 (図 1 (C)) において等辺台形形状を有し、側面視 (図 1 (D)) において矩形形状を有している。平面視における等辺台形形状は、高さ H と、外周の幅 W D とを有する。また、側面視の矩形形状は、奥行き D P 及び高さ H を有する。外周の幅 W D は、第 1 の磁石体 110 の直径の寸法と、第 1 の磁石体 110 の極数 M 1 とに応じて決められる。例えば、第 1 の磁石体 110 の直径を 30 mm とし、その極数 M 1 を 64 とし、小磁石ペア 111 p s の高さ H を 5 mm とした場合には、 $W D = 1.47 \text{ mm}$ となり、小磁石ペア 111 p s のサイズが極めて小さなものとなる。仮に、このような微小サイズの等辺台形柱形状の全体をすべて磁石で製造しようとする、そのためのテーパ加工が困難である。そこで、本実施形態では、直方体形状の 2 つの小磁石 111 s を被覆部材 112 で被覆することによって、全体として等辺台形柱形状の小磁石ペア 111 p s を形成している。被覆部材 112 は、直方体形状の 2 つの小磁石 111 s の周囲の少なくとも一部を被覆し

、かつ、小磁石ペア 1 1 1 p s の全体の形状を等辺台形形状とするために設けられている部材である。被覆部材 1 1 2 の材料としては、加工のし易さ及び耐久性を考慮して、アルミ材や樹脂などの非磁性体材料を利用することが可能である。

【 0 0 2 0 】

図 1 (D) に拡大して示すように、個々の小磁石 1 1 1 s は、回転軸 C から個々の小磁石 1 1 1 s の中心を通る方向 (すなわち径方向) に平行な方向に沿って平行着磁されている。また、各小磁石ペア 1 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 1 1 1 s 同士は、逆向きに磁化されている。図 1 (E) に示すように、多数の小磁石ペア 1 1 1 p s を回転体 4 0 0 の外周に並べることによって、多極の第 1 の磁石体 1 1 0 を容易に作成することができる。例えば、64 個の小磁石ペア 1 1 1 p s を円環状に並べることによって、64 極の第 1 の磁石体 1 1 0 を構成することが可能である。この構成では、小磁石ペア 1 1 1 p s は、回転体 4 0 0 の回転軸 C 廻りの円形の軌道に沿って配置されていることが理解できる。なお、図 1 (A) に示すように、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の中心は、各小磁石ペア 1 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 1 1 1 s の中間を通る直線 (すなわち 2 つの小磁石 1 1 1 s の境界) が辿る軌跡の上に配置されることが好ましい。

【 0 0 2 1 】

第 2 の磁石体 2 1 0 は、第 1 の磁石体 1 1 0 の内側において、エンコーダー 1 0 0 A の回転軸 C の廻りに配置された 2 個の半円板状の小磁石 2 1 1 s で形成されており、全体として円板形状を有する 2 極の磁石体である。第 2 の磁石体 2 1 0 の個々の小磁石 2 1 1 s の着磁方向は、回転軸 C と平行な方向であり、2 つの小磁石 2 1 1 s は逆方向に磁化されている。第 2 の磁石体 2 1 0 の中心は、回転体 4 0 0 の回転軸 C 上の位置に配置することが好ましい。また、第 2 の 2 軸磁気センサー回路 2 3 0 の中心は、回転体 4 0 0 の回転軸 C 上の位置に配置されている。

【 0 0 2 2 】

なお、小磁石 1 1 1 s を単に「磁石 1 1 1 s」と呼び、小磁石ペア 1 1 1 p s を「磁石ペア 1 1 1 p s」と呼び、磁石体 1 1 0 を「磁石集合体 1 1 0」と呼ぶことも可能である。小磁石 2 1 1 s、小磁石ペア 2 1 1 p s、及び磁石体 2 1 0 についても同様である。

【 0 0 2 3 】

図 2 は、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 で得られる各種の検出信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$, D 1 を示すグラフである。なお、2 つの 2 軸磁気センサー回路 1 3 0, 2 3 0 の構成と動作は同一なので、以下では主として第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 を対象として説明を行う。図 2 のグラフの横軸は、エンコーダー 1 0 0 A (すなわち回転体) の回転角 θ_r である。この回転角 θ_r を、「機械角」とも呼ぶ。第 1 の磁石体 1 1 0 の周方向に沿った磁場は、隣接する 2 つの小磁石ペア 1 1 1 p s を 1 周期とする正弦波状の変化を示す。この磁場の 1 周期毎の位置は、磁気角 θ_m によって表される。図 2 の上部に示した信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ は、この磁気角 θ_m に応じた正弦波信号及び余弦波信号である。但し、図 2 では、図示の便宜上、第 1 の磁石体 1 1 0 が 8 極の場合の例を示している。図 2 の下部に示した信号 D 1 は、磁気角 θ_m の各周期において 0 から最大値まで直線的に変化する信号であり、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 から外部回路に出力される磁気角出力 D 1 である。磁気角出力 D 1 は、例えば、正弦波信号 $\sin \theta_m$ と余弦波信号 $\cos \theta_m$ をデコードすることによって生成することができる。

【 0 0 2 4 】

図 3 は、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の内部に含まれる複数のホール素子の配列例と、それらの感磁方向を示す説明図である。ここでは、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の表面に平行な方向として、互いに直交する X 軸方向と、Y 軸方向とを描いている。Z 軸方向は、X 軸方向及び Y 軸方向に直交しており、小磁石 1 1 1 s (又は 2 1 1 s) の着磁方向と平行な方向である。また、ホール素子の感磁方向 (磁力線の検出方向) として、S 極から N 極に向かう方向を矢印で示している。内部に黒丸を含む白丸は、紙面の裏側から表側に向かう方向が感磁方向であることを示す。また、内部に「X」を含む白丸は、紙面の表側から裏側に向かう方向が感磁方向であることを示す。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 5 】

図 3 (A) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、X 軸方向を感磁方向とする 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 と、Y 軸方向を感磁方向とする 2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 とを有している。なお、X 軸ホール素子の個数は、複数とすることが好ましく、2 個に限らず 3 個以上でも良い。これは Y 軸ホール素子も同様である。後述するように、複数の X 軸ホール素子 X 1 , X 2 から第 1 磁気角信号 $\sin \theta_m$ が生成され、複数の Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 から第 2 磁気角信号 $\cos \theta_m$ が生成される。この点はさらに後述する。

【 0 0 2 6 】

図 3 (B) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、第 1 組のホール素子 Y X 1 , Y X 2 と、第 2 組のホール素子 X Y 1 , X Y 2 とを有している。これらの 2 組のホール素子は、X 軸方向と Y 軸方向に対して 4 5 度傾いた方向を感磁方向としている。図 3 (C) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 と、2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 とを有している。図 3 (C) の回路は、2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 と 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の感磁方向が互いに向き合っている点で、図 3 (A) の回路と異なっている。図 3 (D) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、4 つの Y 軸ホール素子 Y 1 a , Y 1 b , Y 2 a , Y 2 b と、4 つの Z 軸ホール素子 Z 1 a , Z 1 b , Z 2 a , Z 2 b とを有している。図 3 (D) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 を用いる場合には、上方の 2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 a , Y 1 b の出力を加算し、下方の 2 つの Y 軸ホール素子 Y 2 a , Y 2 b を加算すれば、図 3 (A) の 2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 の出力と等価な出力を得ることが可能である。Z 軸ホール素子 Z 1 a , Z 1 b , Z 2 a , Z 2 b についても同様である。図 3 (B) ~ (D) の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 のいずれを使用しても、その複数のホール素子の出力を合成することによって、磁気角信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ を生成することが可能である。なお、これらの例から理解できるように、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、直交する 2 つの方向に沿った磁場を検出することが可能な回路である。また、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 において、複数個の X 軸センサー素子が、X 軸に沿って互いに離れた部位に配置された第 1 組の X 軸ホール素子と第 2 組の X 軸ホール素子とを含み、同様に、複数個の Y 軸センサー素子が、Y 軸に沿って互いに離れた部位に配置された第 1 組の Y 軸ホール素子と第 2 組の Y 軸ホール素子とを含むように構成することが可能である。なお、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の中心は、これらの複数のホール素子の間の中央位置に一致している。

【 0 0 2 7 】

図 4 は、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の回路構成と動作を示す説明図である。ここでは、図 3 (A) に示したホール素子の構成を使用している。2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、X 軸ホール素子 X 1 , X 2 及び Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 の他に、増幅回路 1 3 1 , 1 3 2 と、A/D 変換回路 1 3 3 , 1 3 4 と、信号処理回路 1 3 5 とを有している。第 1 の増幅回路 1 3 1 には 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力が入力され、第 2 の増幅回路 1 3 2 には 2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 の出力が入力されている。図 4 (B) に示すように、2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力は、それぞれ第 1 の正弦波状の信号である。また、2 つの Y 軸ホール素子 Y 1 , Y 2 の出力は、第 1 の正弦波から 9 0 度位相がずれた第 2 の正弦波状 (余弦波状) の信号である。第 1 の増幅回路 1 3 1 は、2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力の差分 ($X_1 - X_2$) を取る差動増幅器として構成されている。この理由は、第 1 の増幅回路 1 3 1 に入力される 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力の正負の符号が逆となるように、ホール素子 X 1 , X 2 の回路や配線が構成されているからである。図 4 (B) の例では、2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力は、符号が逆で絶対値が等しい信号として描かれている。但し、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の設置位置や磁石の磁束歪みによる磁極位置によっては、これらの 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力の絶対値が互いに異なる場合もある。しかし、この場合にも、第 1 の増幅回路 1 3 1 で 2 つの X 軸ホール素子 X 1 , X 2 の出力の差分 ($X_1 - X_2$) を取ることによって、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の設置位置や磁石の磁束歪みによる磁極位置のずれに関わらず、磁気角 θ_m に応じた正しい正弦波出力を得ることが可能である。これらの点は、Y 軸

ホール素子 Y_1 , Y_2 及び第 2 の増幅回路 132 に関しても同様である。このように、複数の X 軸ホール素子の出力信号の差を取ることによって正弦波信号 ($X_1 - X_2$) を生成し、複数の Y 軸ホール素子の出力信号の差を取るによって正弦波信号 ($X_1 - X_2$) とは位相が 90 度異なる余弦波信号 ($Y_1 - Y_2$) を生成することができる。また、正弦波信号 ($X_1 - X_2$) と余弦波信号 ($Y_1 - Y_2$) に基づいて、回転体の位置 (回転位置) を示す磁気角出力 D_1 を生成することができる。

【0028】

なお、第 1 の増幅回路 131 に入力される 2 つの X 軸ホール素子 X_1 , X_2 の出力は、正負符号が同一の信号としてもよい。この場合には、第 1 の増幅回路 131 は、加算増幅器として構成される。但し、第 1 の増幅回路 131 を差動増幅器として構成すれば、2 つの出力信号 X_1 , X_2 に共通のノイズ (例えば、電磁コイルの PWM 制御に伴う高周波ノイズ) が含まれている場合にも、それらの差分 ($X_1 - X_2$) を取ることによってノイズを軽減できる点で好ましい。これらの点は、第 2 の増幅回路 132 も同様である。

【0029】

これらの増幅回路 131 , 132 の出力 ($X_1 - X_2$) , ($Y_1 - Y_2$) は、AD 変換回路 133 , 134 でそれぞれデジタル信号に変換されて、磁気角信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ となる。信号処理回路 135 は、これらの磁気角信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ に基づいたデコード演算を行うことによって、図 2 に示した磁気角出力 D_1 を生成する。信号処理回路 135 は、更に、磁気角出力 D_1 を利用して、図 4 (C) に示す 2 相パルス信号 P_a , P_b と、周期信号 Z とを生成する。

【0030】

2 相パルス信号 P_a , P_b と、周期信号 Z は、例えば以下のように生成される。磁気角出力 D_1 は、磁気角 θ_m を複数のビットで表した信号である。例えば、磁気角出力 D_1 が 12 ビット信号として構成されている場合には、磁気角 θ_m が 0 から 2π まで変化する間に、磁気角出力 D_1 の値は 0 から $4095 (= 2^{12} - 1)$ まで直線的に変化する。2 相パルス信号 P_a , P_b は、位相が互いに 90 度ずれた信号であり、光学式のインクリメンタルエンコーダーの A 相出力及び B 相出力に相当する信号である。周期信号 Z は、磁気角 θ_m が 2π 変化するたびに 1 パルス発生する信号であり、光学式のインクリメンタルエンコーダーの Z 相信号に相当する信号である。例えば、 A 相パルス信号 P_a は、磁気角出力 D_1 の最下位から 2 番目のビットの変化を示す信号として生成される。また、 B 相パルス信号 P_b は、角度信号 D_1 の最下位の 2 ビットの排他的論理和 (XOR) を取った信号として生成される。周期信号 Z は、角度信号 D_1 の全ビットの否定論理和 (NOR) を取った信号として生成される。角度信号 D_1 が 12 ビットの信号の場合には、2 相パルス信号 P_a , P_b のパルスは、磁気角 θ_m が 2π 変化する間に 1024 個発生する。

【0031】

信号処理回路 135 は、角度信号 D_1 と、正弦波信号 $\sin \theta_m$ と、余弦波信号 $\cos \theta_m$ と、2 相パルス信号 P_a , P_b と、周期信号 Z とを外部に出力することが可能である。ロータリーエンコーダー 100A を使用する装置は、これらの信号のうちのいくつかを用いて位置制御や速度制御を実行することが可能である。

【0032】

ところで、図 1 でも述べたように、第 1 の磁石体 110 の個々の小磁石 111s は、回転軸 C から個々の小磁石 111s の中心を通る方向に平行な方向に磁化されており、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 130 は、その Z 軸 (図 3) が小磁石 111s の磁化方向と平行となるように配置されている。また、第 2 の磁石体 210 の個々の小磁石 211s は、回転軸 C に平行な方向に磁化されており、第 2 の 2 軸磁気センサー回路 230 は、その Z 軸が小磁石 211s の磁化方向と平行となるように配置されている。このような配置を採用した理由は、以下で説明する実験結果を考慮したものである。

【0033】

図 5 は、小磁石に対する 2 軸磁気センサー回路の配置に応じた 2 軸磁気センサー回路の出力レベルを示す説明図である。図 5 (A) に示すように、ここでは、円板状の支持部材

10

20

30

40

50

150の外周に多数の小磁石111sを設けている。但し、図5(A)では図示の便宜上、全体の1/8に相当する部分(中心角で45度の部分)のみを示しており、小磁石111sは8個設けられている。図5(B)は、図5(A)の断面図であり、1つの小磁石111sの断面が示されている。個々の小磁石111sの磁化方向は、回転軸Cから個々の小磁石111sの中心に向かう方向(すなわち径方向)に平行である。この実験では、第1の測定位置SP1と、第2の測定位置SP2に2軸磁気センサー回路130を配置し、それぞれの位置SP1, SP2において磁場をそれぞれ測定した。第1の測定位置SP1は、複数の小磁石111sの表面から上方に0.5mm離れた位置であり、2軸磁気センサー回路130の2つの感磁軸方向(図4のX, Y軸方向)で規定される平面が、小磁石111sの着磁方向と平行となるように2軸磁気センサー回路130を設置した。なお、
 「2つの感磁軸方向で規定される表面」は、2軸磁気センサー回路130の感磁面に相当する。なお、2軸磁気センサー回路130の感磁面は、2軸磁気センサー回路130内に設けられた磁性体の表面と平行な面として規定することも可能である。第2の測定位置SP2は、複数の小磁石111sの外周から0.5mm離れた位置であり、2軸磁気センサー回路130の感磁面が、小磁石111sの着磁方向と直交するように2軸磁気センサー回路130を設置した。図5(C)は、これらの2つの測定位置SP1, SP2における2軸磁気センサー回路130の出力レベルを示している。これから理解できるように、第2の測定位置SP2で検出される磁場の強度は、第1の測定位置SP1で検出される磁場の強度よりも極めて高い。従って、2軸磁気センサー回路130は、その感磁面が、小磁石111sの着磁方向と直交するように設置することが好ましい。換言すれば、小磁石111sは、2軸磁気センサー回路130の感磁面に直交する方向に磁化されていることが好ましい。こうすれば、2軸磁気センサー130の信号レベルがより大きくなるので、エンコーダーの測定精度をより高めることが可能である。なお、小磁石111sの磁化方向は、2軸磁気センサー回路130の感磁面に直交する必要は無いが、2軸磁気センサー回路130の感磁面に交差する方向であることが好ましく、感磁面に直交する方向であることが最も好ましい。

【0034】

図6は、第1の2軸磁気センサー回路130から出力される第1磁気角出力D1と、第2の2軸磁気センサー回路230から出力される第2磁気角出力D2と、の例を示す説明図である。図6の横軸は機械角 θ_r であり、縦軸は2つの2軸磁気センサー回路130, 230の磁気角出力D1, D2である。但し、図6では、図示の便宜上、第1の磁石体110が8極の例を示している。第1の磁石体110が8極の場合には、エンコーダー100Aの支持部材150の1回転(機械角で360度)の間に、第1の磁石体110の小周期区間が4つ発生する。ここで、「小周期区間」とは、第1の磁石体110の磁気角 θ_m が360度(2π)変化する区間を意味する。図6(A)に示す小周期区間値Pxは、これらの4つの小周期区間を区別するための値であり、0~3までの4つの値を取る。後述するように、この小周期区間値Pxは、第2の2軸磁気センサー回路230の磁気角出力から生成される。なお、第1の磁石体110が64極の場合には、エンコーダー100Aの支持部材150の1回転の間に、第1の磁石体110の小周期区間が32個発生する。但し、図6において、エンコーダー100Aの支持部材150の1回転の間に第1の磁石体110の小周期区間が32個発生する図を描くと過度に細かな図となるので、ここでは図示の便宜上、簡略化した図を用いている。

【0035】

図6の例では、2軸磁気センサー回路130, 230の磁気角出力D1, D2は、いずれも12ビットで構成されており、磁気角出力D1, D2は0~4095の間の値を取る。但し、一般には、第1の2軸磁気センサー回路130の第1磁気角出力D1をN1ビット(N1は2以上の整数)のデジタル信号とし、第2の2軸磁気センサー回路230の第2磁気角出力D2をN2ビット(N2は2以上の整数)のデジタル信号とすることができる。ここで、ビット数N1, N2は、同じ値としても良く、異なる値としても良い。

【0036】

10

20

30

40

50

図6(B)に示す第1磁気角出力D1は、第1の磁石体110の回転に伴う磁気角の変化を示しており、機械角 θ_r が360度変化する間に、0から4095までの値が4回繰り返して発生する鋸刃状の変化を示す。すなわち、第1磁気角出力D1は、個々の小周期区間の間に、0から4095まで増加する直線的な変化を示す。一方、図6(A)に示す第2磁気角出力D2は、第2の磁石体210の回転に伴う磁気角の変化を示しており、機械角 θ_r が360度変化する間に0から4095までの値が1回だけ発生する直線的な変化を示す。第2磁気角出力D2の最上位2ビットは、図6(A)に示す小周期区間値Pxとして使用可能である。

【0037】

小周期区間値Pxは、機械角 θ_r の絶対位置を高精度に決定するために使用される。機械角 θ_r は、第2磁気角出力D2のみから12ビットの精度で検出可能である。しかし、小周期区間値Pxと第1磁気角出力D1との両方を使用すれば、更に高精度(高分解能)に機械角 θ_r の絶対位置を決定することができる。具体的には、図6の例において、小周期区間値Pxが2ビットであり、第1磁気角出力D1が12ビットなので、これらの両方を使用して14ビットの精度(分解能)で機械角 θ_r を検出可能である。

【0038】

図7は、2つの2軸磁気センサー回路130, 230の出力を用いて回転体の絶対位置(絶対角度)を決定する位置信号生成部300を示す説明図である。位置信号生成部300は、2つの2軸磁気センサー回路130, 230の磁気角出力D1, D2を合成して、絶対位置出力Dabsを生成する。図7(B)は、位置信号生成部300の処理内容を示している。この例では、第1磁気角出力D1は、最下位ビットM0から最上位ビットM11までの12ビットの信号であり、第2磁気角出力D2も、最下位ビットS0から最上位ビットS11までの12ビットの信号である。第2磁気角出力D2の最上位2ビットS11, S10は、小周期区間値Pxとして使用される。絶対位置出力Dabsは、その最上位2ビットが小周期区間値Pxであり、下位12ビットが第1磁気角出力D1である。この絶対位置出力Dabsは、14ビットの精度で機械角 θ_r の値を表す信号である。

【0039】

なお、本実施形態において、2軸磁気センサー回路130, 230のそれぞれは、複数のホール素子(図3の例参照)を用いている。従って、2軸磁気センサー回路130, 230の電源がオンとなったときに、その時点における回転体の絶対位置(機械角 θ_r)に応じて、図6に示した磁気角出力D1, D2を得ることができ、これらの磁気角出力D1, D2に応じて回転体の絶対位置(機械角 θ_r)を決定することが可能である。従って、2軸磁気センサー回路130, 230の電源オフ時に、その時点における回転体の絶対位置(機械角 θ_r の値)を記憶しておく必要が無く、電源オン時に得られる2つの磁気角出力D1, D2のみから、電源オフ時の回転体の絶対位置を知ることができるという利点がある。

【0040】

ところで、図6の例では、第1磁気角出力D1の小周期区間の境界と、第2磁気角出力D2から得られる小周期区間値Pxの値の変化位置とが一致している。しかしながら、実際の回路では、何らかの誤差によって両者が食い違う不具合が発生する可能性がある。このような不具合を防止するために、位置信号生成部300は、機械角 θ_r の増大に応じて第1磁気角出力D1が最大値D1maxから最小値0に戻るタイミングと、小周期区間値Px(すなわち第2磁気角出力D2の最上位2ビット)がインクリメントするタイミングとが一致するように、小周期区間値Pxの補正を行うことが好ましい。

【0041】

図8は、位置信号生成部300によって行われる小周期区間値Pxの補正対象範囲を示す説明図である。図の下方には、第1磁気角出力D1の鋸刃状の変化が示されており、上方には第2磁気角出力D2の誤差の幅(上下方向の幅)がハッチングで示されている。第1磁気角出力D1は、その最小値0から最大値D1maxの範囲で変化しており、最大値D1maxに到達したあとに、最小値0に戻る。第1磁気角出力D1が最大値D1maxから最小

10

20

30

40

50

値 0 に戻るタイミングと、第 2 磁気角出力 D 2 の最上位 2 ビットがインクリメントするタイミングとが一致していれば、図 7 (B) で示したように、第 2 磁気角出力 D 2 の最上位 2 ビットを小周期区間値 P_x としてそのまま使用できる。一方、両者のタイミングがずれている場合には、小周期区間値 P_x の補正を行う。小周期区間値 P_x の補正が必要となるのは、第 1 磁気角出力 D 1 が最大値 D_{1max} から最小値 0 に戻るタイミングの直後の範囲 R 1 と、そのタイミングの直前の範囲 R 3 である。これらの 2 つの範囲 R 1 , R 3 の中間の範囲 R 2 では、第 2 磁気角出力 D 2 の最上位 2 ビットの値が、小周期区間値 P_x として正しい値を示すので、補正の必要は無い。

【 0 0 4 2 】

図 9 は、小周期区間値 P_x の補正のアルゴリズムの一例を示すフローチャートである。この補正は、位置信号生成部 3 0 0 (図 7) によって行われる。ステップ S 1 0 0 では、第 1 磁気角出力 D 1 のビット数 N_1 と、第 2 磁気角出力 D 2 のビット数 N_2 と、小周期区間値 P_x のビット数 N_x と、が設定される。また、パラメータ $N_{ss} (= N_2 - N_x)$ 、 $D_{1max} (= 2^{N_1} - 1)$ も設定される。本実施形態では、 $N_1 = N_2 = 12$, $N_x = 2$, $N_{ss} = 10$, $D_{1max} = 4095$ である。

【 0 0 4 3 】

ステップ S 1 1 0 では、位置信号生成部 3 0 0 が、2 つの 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 (図 7) から磁気角出力 D 1 , D 2 を受信する。ステップ S 1 2 0 では、第 1 磁気角出力 D 1 が、図 8 に示した 3 つの範囲 R 1 , R 2 , R 3 のいずれにあるかが判定される。図 9 の例では、第 1 の範囲 R 1 を $0 \leq D_1 < (D_{1max} / 4)$ とし、第 2 の範囲 R 2 を $(D_{1max} / 4) \leq D_1 < (D_{1max} * 3 / 4)$ とし、第 3 の範囲 R 3 を $(D_{1max} * 3 / 4) \leq D_1 \leq D_{1max}$ としている。第 1 の範囲 R 1 と第 3 の範囲 R 3 では、小周期区間値 P_x を補正するために、第 2 磁気角出力 D 2 の補正を実行する。

【 0 0 4 4 】

補正の実行工程であるステップ S 1 3 0 ~ S 1 5 0 は、以下の考えに基づいて実施される。

(1) 第 1 磁気角出力 D 1 が第 1 の範囲 R 1 にある場合には、第 2 磁気角出力 D 2 の上位 2 ビットで表される小周期区間値 P_x が、誤って 1 つ小さな値になっている可能性がある。そこで、この可能性を排除するために、第 2 磁気角出力 D 2 の下位 N_{ss} ビットで表される最大値 $(= 2^{N_{ss}})$ の半分の値を第 2 磁気角出力 D 2 に加算して、その上位 N_x ビットを小周期区間値 P_x として使用する (ステップ S 1 3 0 , S 1 5 0) 。

(2) 第 1 磁気角出力 D 1 が第 2 の範囲 R 2 にある場合には、第 2 磁気角出力 D 2 の最上位 2 ビットをそのまま小周期区間値 P_x として使用する (ステップ S 1 5 0) 。

(3) 第 1 磁気角出力 D 1 が第 3 の範囲 R 3 にある場合には、第 2 磁気角出力 D 2 の上位 2 ビットで表される小周期区間値 P_x が、誤って 1 つ大きな値になっている可能性がある。そこで、この可能性を排除するため、第 2 磁気角出力 D 2 の下位 N_{ss} ビットで表される最大値 $(= 2^{N_{ss}})$ の半分の値を第 2 磁気角出力 D 2 から減算して、その上位 N_x ビットを小周期区間値 P_x として使用する (ステップ S 1 4 0 , S 1 5 0) 。

【 0 0 4 5 】

このような補正を行うことによって、第 1 磁気角出力 D 1 の小周期区間の境界と、小周期区間値 P_x の変化時点とが常に一致するように、小周期区間値 P_x を決定することが可能である。発明者の計算によれば、第 2 磁気角出力 D 2 の磁気角誤差が $\pm 2^{N_1 - N_x - 2}$ 以下であれば、上記の補正によって正しい小周期区間値 P_x を得ることが可能である。例えば、 $N_1 = 12$, $N_x = 2$ の場合には、許容誤差は $\pm 2^8 = \pm 256$ である。この許容誤差はかなり大きいので、誤差に対する耐性が非常に大きく、実用上極めて有効な補正であることが理解できる。但し、磁気角出力 D 1 , D 2 の誤差が無視できる程度のものであれば、小周期区間値 P_x の補正は不要である。

【 0 0 4 6 】

なお、補正を要する範囲 R 1 , R 3 の最小幅は、磁気角出力 D 1 , D 2 の誤差の大きさに応じて変わる。従って、これらの 3 つの範囲 R 1 ~ R 3 を、上述とは異なる所定の範囲

10

20

30

40

50

にそれぞれ設定することが可能である。但し、3つの範囲 $R_1 \sim R_3$ のそれぞれは、幅がゼロでない範囲とすることが好ましい。また、小周期区間の境界の両側にある範囲 R_1 ， R_3 は、同じ幅とすることが好ましい。

【0047】

このように、位置信号生成部300は、第1の2軸磁気センサー回路130の第1磁気角出力 D_1 と、第2の2軸磁気センサー回路230の第2磁気角出力 D_2 とに応じて、回転体の絶対位置（機械角 θ_r ）を示す位置信号（絶対位置出力 D_{abs} ）を生成する。この位置信号 D_{abs} を使用すれば、1つの2軸磁気センサー回路130（又は230）よりも高精度（高解像度）で位置を決定することが可能である。また、上述したように、本実施形態では、2軸磁気センサー回路130，230が複数のホール素子を用いているので、2軸磁気センサー回路130，230の電源オン時に得られる2つの磁気角出力 D_1 ， D_2 のみから、電源オフ時の回転体の絶対位置を直読で知ることができる。

10

【0048】

なお、第1の磁石体110の極数を M_1 とし、第2の磁石体210の極数を M_2 とした場合に、 M_1 ， M_2 をそれぞれ偶数とすることが好ましく、特に、 M_1 を4以上の偶数とし、 M_2 を2以上の偶数とすることが好ましい。こうすれば、1つの磁石体を用いる場合に比べて、より高精度に位置検出を行うことが可能である。

【0049】

また、第1の磁石体110の極数 M_1 と、第2の磁石体210の極数 M_2 は、 $M_1/2$ と $M_2/2$ が互いに素である整数であることが好ましい。ここで、2つの整数が「互いに素」とは、両者が1以外の共通の約数を持たないことを意味する。 $M_1/2$ と $M_2/2$ が互いに素となる整数であれば、第1の磁石体110の磁気角 2π の区間（図6の小周期区間）の境界と、第2の磁石体210の磁気角 2π の区間の境界とが一致する位置が、機械角 $\theta_r = 0$ の位置だけになるので、2つの磁気角出力 D_1 ， D_2 から機械角 θ_r の絶対値を決定することができる。なお、図6及び図7の例では、 $M_1 = 8 = 2^3$ ， $M_2 = 2$ である。また、図1に示すエンコーダー100Aでは、 $M_1 = 64 = 2^6$ ， $M_2 = 2$ である。

20

【0050】

一般に、第2磁気角出力 D_2 の最上位の数ビットを小周期区間値 P_x として利用するためには、第1の磁石体110の極数 M_1 を 2^{Q+1} （ Q は1以上の整数）に設定し、第2の磁石体210の極数 M_2 を2に設定することが好ましい。このとき、位置信号生成部300は、第2磁気角出力 D_2 の最上位 Q ビットを最上位に配置するとともに、その下に、第1磁気角出力 D_1 の全ビット（ N_1 ビット）を配置した（ $N_1 + Q$ ）ビットの信号を、絶対位置出力 D_{abs} として生成することが好ましい。例えば、図6，図7の例では、 $N_1 = 12$ ， $Q = 2$ なので、絶対位置出力 D_{abs} は14ビットの信号となる。

30

【0051】

図10は、第1の磁石体110の極数 M_1 を変更した場合の絶対位置出力 D_{abs} のビット数を示す説明図である。この例では、2つの磁気角出力 D_1 ， D_2 のビット数はいずれも12ビットと仮定している。第1の磁石体110の極数 M_1 が変わると、これに応じてエンコーダー100Aの回転体400の一回転当たりの小周期区間の発生個数が変化するので、小周期区間値 P_x のビット数 Q もこれに応じて変化する。絶対位置出力 D_{abs} のビット数は、上述したように、第1磁気角出力 D_1 のビット数 N_1 と、小周期区間値 P_x のビット数 Q とを足した値（ $N_1 + Q$ ）となる。

40

【0052】

このように、第1実施形態のロータリーエンコーダー100Aは、第1の磁石体110に含まれる個々の小磁石111sが、2軸磁気センサー回路130の感磁面に交差する方向に磁化されているので、2軸磁気センサー回路130が強い磁場を検出することができ、この結果、解像度の高い磁気角出力 D_1 を得ることが可能である。また、2軸磁気センサー回路130は、複数のX軸ホール素子 X_1 ， X_2 と複数のY軸ホール素子 Y_1 ， Y_2 とを有しており、それらのホール素子の出力信号に応じて磁気角出力 D_1 を生成するので、第1の磁石体110に対して2軸磁気センサー回路130の設置位置が多少ずれた場合

50

にも、正確な磁気角出力 D 1 を得ることが可能である。これらの特徴点は、第 2 の磁石体 2 1 0 及び第 2 の 2 軸磁気センサー回路 2 3 0 についても同様である。

【 0 0 5 3 】

更に、第 1 実施形態では、位置信号生成部 3 0 0 が、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の第 1 磁気角出力 D 1 と第 2 の 2 軸磁気センサー回路 2 3 0 の第 2 磁気角出力 D 2 とに応じて位置信号 D abs を生成するので、1 つの 2 軸磁気センサー回路のみを用いる場合に比べて更に高精度に位置検出を行うことが可能である。

【 0 0 5 4 】

B . 第 2 ～ 6 実施形態（ロータリーエンコーダー）

図 1 1 は、第 2 実施形態としてのロータリーエンコーダー 1 0 0 B の構成を示す説明図である。このロータリーエンコーダー 1 0 0 B が第 1 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 A（図 1）と異なる点は、第 1 の磁石体 1 1 0 が回転体 4 0 0 の外周では無く、回転体 4 0 0 の表面に設けられている点、及び、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の配置が第 1 の磁石体 1 1 0 の位置に応じて変更されている点である。すなわち、第 2 実施形態のエンコーダー 1 0 0 B では、第 1 の磁石体 1 1 0 の小磁石ペア 1 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 1 1 1 s は、回転体 4 0 0 の径方向に沿って配列されている。また、個々の小磁石 1 1 1 s は、回転体 4 0 0 の回転軸 C に平行な方向に磁化されている。また、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 は、その Z 軸方向が、これらの小磁石 1 1 1 s の磁化方向と一致するように配置されている。なお、第 2 実施形態は、複数組の小磁石ペア 1 1 1 p s が、回転体 4 0 0 の回転軸 C 廻りの円形の軌道に沿って配置されている点で、第 1 実施形態と共通していることが理解できる。また、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の中心が、各小磁石ペア 1 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 1 1 1 s の間の中間を通る直線が辿る軌跡の上に配置されている点でも第 1 実施形態と共通している。なお、第 2 の磁石体 2 1 0 と第 2 の 2 軸磁気センサー回路 2 3 0 の配置は第 1 実施形態と同じである。第 2 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 B では、2 つの 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 を同一平面上に並べて配置できるので、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 の設置や配線の引き回しが第 1 実施形態に比べて容易である。

【 0 0 5 5 】

図 1 2 は、第 3 実施形態としてのロータリーエンコーダー 1 0 0 C の構成を示す説明図である。このロータリーエンコーダー 1 0 0 C が第 2 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 B（図 1 1）と異なる点は、第 2 の磁石体 2 1 0 が円板状では無く、直方体状である点だけであり、第 1 の磁石体 1 1 0 を含む回転体 4 0 0 のその他の構成は第 2 実施形態と同じである。第 3 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 C では、第 2 の磁石体 2 1 0 が直方体状なので、その製造がより容易であるという利点がある。

【 0 0 5 6 】

図 1 3 は、第 4 実施形態としてのロータリーエンコーダー 1 0 0 D の構成を示す説明図である。このロータリーエンコーダー 1 0 0 D が第 2 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 B（図 1 1）と異なる点は、第 1 の磁石体 1 1 0 の小磁石ペア 1 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 1 1 1 s が互いに密着（又は接触）しておらず、離間している点だけであり、第 2 の磁石体 2 1 0 を含む回転体 4 0 0 のその他の構成は第 2 実施形態と同じである。第 4 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 D では、2 つの小磁石 1 1 1 s の間の距離と、2 つの小磁石 1 1 1 s の間に設ける部材の材質と、の少なくとも一方を調整することによって、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の検出信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ （図 2）の形状を、より正弦波に近いものに調整することが可能である。

【 0 0 5 7 】

図 1 4 は、第 5 実施形態としてのロータリーエンコーダー 1 0 0 E の構成を示す説明図である。このロータリーエンコーダー 1 0 0 E が第 2 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 B（図 1 1）と異なる点は、第 2 の磁石体 2 1 0 が、2 組の小磁石ペア 2 1 1 p s で構成されている点だけであり、第 1 の磁石体 1 1 0 を含む回転体 4 0 0 のその他の構成は第 2 実施形態と同じである。第 2 の磁石体 2 1 0 の全体は、中空円筒状であり、各組の

10

20

30

40

50

小磁石ペア 2 1 1 p s は半円筒状である。また、小磁石ペア 2 1 1 p s を構成する 2 つの小磁石 2 1 1 s も、半円筒状である。個々の小磁石 2 1 1 s の磁化方向は、回転体 4 0 0 の回転軸 C に平行な方向であり、2 つの小磁石 2 1 1 s は互いに逆向きに磁化されている。この第 2 の磁石体 2 1 0 の極数は 2 である。但し、小磁石ペア 2 1 1 p s の円弧の角度をより小さくして、中空円筒状の第 2 の磁石体 2 1 0 を構成する小磁石ペア 2 1 1 p s の数を増加すれば、第 2 の磁石体 2 1 0 の極数を任意に変更することが可能である。

【 0 0 5 8 】

図 1 5 は、第 6 実施形態としてのロータリーエンコーダー 1 0 0 F の構成を示す説明図である。このロータリーエンコーダー 1 0 0 F は、中空円筒状の支持部材 1 5 0 の廻りに、同径の環状の 2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 が、回転軸 C に平行な方向に沿って並列に配置された構成を有している。2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 の内周には、ヨーク部材 1 2 0 , 2 2 0 がそれぞれ設けられている。また、2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 の間には、磁気遮蔽部材 1 6 0 が設けられている。基板 1 4 0 には、2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 の外周面に対して所定のギャップを介した位置に 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 が設けられている。

10

【 0 0 5 9 】

第 1 の磁石体 1 1 0 は 8 組の小磁石ペア 1 1 1 p s で構成されており、その極数 M 1 は 8 である。第 2 の磁石体 2 1 0 は 2 組の小磁石ペア 2 1 1 p s で構成されており、その極数 M 2 は 2 である。但し、これらの極数 M 1 , M 2 は、図 1 0 で説明したように、種々の整数に設定することが可能である。2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 の個々の小磁石 1 1 1 s , 2 1 1 s の着磁方向は、回転軸 C から各小磁石 1 1 1 s , 2 1 1 s の中心を通る方向（径方向）に平行な方向である。この着磁方向は、2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 の Z 軸方向に平行である。他の構成や動作は、第 1 ~ 第 5 実施形態で説明したものと同様である。

20

【 0 0 6 0 】

第 2 ~ 第 6 実施形態のロータリーエンコーダー 1 0 0 B ~ 1 0 0 F も、第 1 実施形態と同様の効果を有する。第 1 ~ 第 5 実施形態のように円板状の回転体 4 0 0 に設けられた 2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 を使用するか、あるいは、第 6 実施形態のように円筒状の回転体（支持部材 1 5 0 ）に設けられた同径の 2 つの磁石体 1 1 0 , 2 1 0 を使用するかは、エンコーダーの用途や空間的制約によって適宜選択可能である。例えば、より外径の小さな空間にエンコーダーを配置したい場合には、第 6 実施形態の方が第 1 ~ 第 5 実施形態よりも有利である。

30

【 0 0 6 1 】

C . 第 7 実施形態（エンコーダーを備える電気機械装置）

図 1 6 は、本発明の実施形態としてのロータリーエンコーダーを備える電動モーター 5 0 0 の電氣的構成を示すブロック図である。電動モーター 5 0 0 のモーター部として、ローター 5 1 0 と、2 相分の電磁コイル 5 2 2 A , 5 2 2 B が描かれている。電磁コイル 5 2 2 A , 5 2 2 B は、図示しないステーターに設けられている。電動モーター 5 0 0 の回転軸 5 3 0 には、2 つの 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 , 2 3 0 を含むロータリーエンコーダー 1 0 0 が接続されている。このロータリーエンコーダー 1 0 0 としては、上述した第 1 ~ 第 6 実施形態のエンコーダーを利用可能である。制御部 6 0 0 は、主制御回路 6 1 0 と、2 相分の駆動信号生成部 6 2 0 A , 6 2 0 B と、2 相分の駆動回路 6 3 0 A , 6 3 0 B とを有している。主制御回路 6 1 0 には、第 1 の 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 の出力信号 D 1 , P a , P b , Z（図 4 参照）と、第 2 の 2 軸磁気センサー回路 2 3 0 の出力信号 D 2 とが供給されており、これらの信号に基づいて、位置制御や速度制御を実行する。主制御回路 6 1 0 の内部構成については後述する。2 相分の駆動信号生成部 6 2 0 A , 6 2 0 B は、1 つの 2 軸磁気センサー回路 1 3 0 から、正弦波と余弦波を示すデジタル信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ を受け取り、これらのデジタル信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ に基づく P W M 制御を実行することによって 2 相分の駆動信号を生成する。これらの駆動信号は、駆動回路 6 3 0 A , 6 3 0 B にそれぞれ供給される。駆動回路 6 3 0 A , 6 3 0 B は、いわゆるブリッジ

40

50

ドライバー回路である。正弦波状のデジタル信号 $\sin \theta_m$, $\cos \theta_m$ に基づくPWM制御によって2相分の駆動信号を生成する方法や、その回路構成については、例えば、本出願人により開示された特開2008-17678号公報の図10に示された回路(AD変換部を除く)を利用することが可能である。なお、本実施形態では、1つの2軸磁気センサー回路130から出力される正弦波信号 $\sin \theta_m$ と余弦波信号 $\cos \theta_m$ とを用いて2相分の駆動信号を生成するので、2つの磁気センサーを用いる場合に比べて、2つのセンサー位置相互のズレに起因する駆動信号の位相ズレが発生しない点で好ましい。この結果、モータの効率を高めることが可能である。

【0062】

図17は、主制御回路610の内部構成を示すブロック図である。主制御回路610の通信インターフェイス710は、第1の2軸磁気センサー回路130から第1磁気角出力D1を受信し、第2の2軸磁気センサー回路230から第2磁気角出力D2を受信する。受信された磁気角出力D1, D2は、データ受信部720を介して位置信号生成部730に供給される。この位置信号生成部730は、図7~図9で説明した位置信号生成部300と同じ機能を有する。位置信号生成部730で得られた絶対位置出力Dabsは、角速度算出部740に供給され、ローター510の角速度(回転速度)が算出される。また、この角速度は、角加速度算出部750に供給され、ローター510の角加速度が算出される。第1の2軸磁気センサー回路130の出力信号Pa, Pb, Z(図4)は、回転数算出部760に供給される。

【0063】

図18は、回転数算出部760の内部構成と動作を示す説明図である。B相パルス信号Pbは、Dフリップフロップ761のデータ入力端子に供給され、A相パルス信号Paはクロック端子に供給される。Dフリップフロップ761の出力であるアップダウン信号Ua/Daは、アップダウンカウンタ762の入力端子に供給される。アップダウン信号Ua/Daのハイレベルは、ローター510の回転方向が正方向(順方向)であることを示し、ローレベルは逆方向であることを示す。アップダウンカウンタ762のクロック端子には、周期信号Zが供給されており、周期信号の立ち上がりエッジに応じてカウント値を変更する。すなわち、アップダウン信号Ua/Daがハイレベルの場合にはカウント値が1つインクリメントされ、アップダウン信号Ua/Daがローレベルの場合にはカウント値が1つデクリメントされる。アップダウンカウンタ762のカウント値は、ラッチ763に供給される。ラッチ763のクロック端子には、周期信号Zが供給されており、周期信号Zの立ち下がりエッジに応じてカウント値Dnがラッチ763に保持される。ラッチ763の出力は、ローター510の回転数Nrとして外部に出力される。この回転数Nrは、電動モーター500によって駆動される部材(例えばロボットの関節)に関して、その所定の基準位置からの電動モーター500の回転数を示している。この回転数Nrは、回転数記憶部770(図17)に供給されて記憶される。

【0064】

図17の主制御回路610は、更に、入出力インターフェイス780と、レジスタ790と、MPU795とを有している。入出力インターフェイス780は、上述した回路730, 740, 750, 760, 790, 795に接続されており、必要に応じてこれらの回路からの出力を外部に供給する。レジスタ790は、第1の磁石体110の極数や、ローター510の絶対位置(機械角 θ_r)等のデータを一次的に格納している。回転数記憶部770やレジスタ790は、制御部600の電源オフ時においてそれぞれの記憶内容を保持するために、電池800でバックアップされていることが好ましい。こうすれば、例えば、電動モーターがロボットの関節の駆動源として使用されている場合に、ロボットの電源オフ時の関節の位置を回転数記憶部770やレジスタ790内の記憶内容に基づいて、次の電源オンの際に、関節の位置を正しく認識して制御を行うことが可能となる。MPU(Micro Processing Unit)795は、電動モーター500に関する各種の制御(例えばサーボ制御)を実行する。なお、MPU795が実行する制御処理は、図示しないメモリー内に格納されたコンピュータプログラムをMPU795が実行することに

10

20

30

40

50

よって実現される。このように、上述した実施形態のエンコーダーを用いて電気機械装置を構成すれば、高精度に位置検出を行いつつ電気機械装置を制御することが可能である。

【0065】

なお、エンコーダーは、駆動力を発生する電気機械装置に限らず、発電を行う（すなわち、回生を行う）電気機械装置や、駆動と回生の両方を行うことが可能な電気機械装置に適用可能である。このような電気機械装置としては、例えば、2相ACブラシレスモーター、3相ACブラシレスモーター、3相同期モーターなどの各種のモーターや、ジェネレーター、モーター/ジェネレーターが存在する。これらの電気機械装置に用いるエンコーダーとしては、上述した第1～第6実施形態で説明した各種のエンコーダーを使用可能である。これらの各種のエンコーダーを利用した電気機械装置においても、電気機械装置における駆動又は回生用の磁石体を、エンコーダーの第1の磁石体としても利用することが好ましい。但し、磁石体を共用せずに、電気機械装置の外部にエンコーダーを接続するようにしてもよい。

10

【0066】

D．エンコーダーを備える電気機械装置を利用した各種装置

図19は、上記実施形態の電気機械装置を利用した双腕7軸ロボットの一例を示す説明図である。双腕7軸ロボット3450は、関節モーター3460と、把持部モーター3470と、アーム3480と、把持部3490と、を備える。関節モーター3460は、肩、肘、手首等の各関節部に相当する位置に配置されている。関節モーター3460は、アーム3480と把持部3490とを、3次元的に動作させるため、各関節につき2つのモーターを備えている。また、把持部モーター3470は、把持部3490を開閉し、把持部3490に物を掴ませる。双腕7軸ロボット3450において、関節モーター3460あるいは把持部モーター3470としては、上述したエンコーダー付きの電気機械装置を用いても良い。

20

【0067】

図20は、上記実施形態の電気機械装置を利用した鉄道車両を示す説明図である。この鉄道車両3500は、変速装置付モーター3510と、車輪3520とを有している。この変速装置付モーター3510は、車輪3520を駆動する。さらに、変速装置付モーター3510は、鉄道車両3500の制動時には発電機として利用され、電力が回生される。なお、変速装置付モーター3510としては、上述したエンコーダー付きの電気機械装置を用いても良い。

30

【0068】

図19及び図20の例から理解できるように、実施形態のエンコーダーを有する電気機械装置は、ロボットや、車両などの移動体を含む各種の装置に利用可能である。

【0069】

E．変形例：

なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。

【0070】

40

・変形例1：

上述した各種の実施形態では、エンコーダーに第1の磁石体と第2の磁石体の2つの磁石体を設けるものとしたが、いずれか一方の磁石体のみを設けるようにしてもよい。エンコーダーに1つの磁石体のみを設ける場合には、その磁石体の極数Mは偶数（2の倍数）とすることが好ましい。但し、2つの磁石体を設けるようにすれば、エンコーダーの回転体の絶対位置を検出できる点でより好ましい。

【0071】

・変形例2：

上述した各種の実施形態では、直方体形状の小磁石111s，211sを利用していたが、この代わりに、強磁性薄膜を用いて小磁石111s，211sの少なくとも一方を形

50

成してもよい。すなわち、強磁性薄膜をその厚みに磁化することによって、薄くて強力な磁石を形成することが可能である。強磁性薄膜を使用すれば、エンコーダーのサイズをよりコンパクトにすることが可能である。

【 0 0 7 2 】

・変形例 3 :

本願発明は、ロータリーエンコーダーのみに限らず、リニアエンコーダーにも適用可能である。

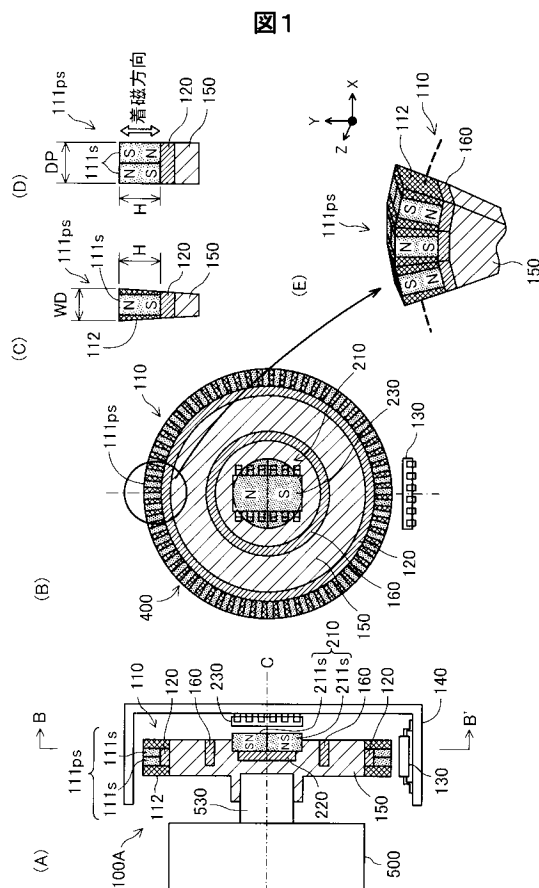
【 符号の説明 】

【 0 0 7 3 】

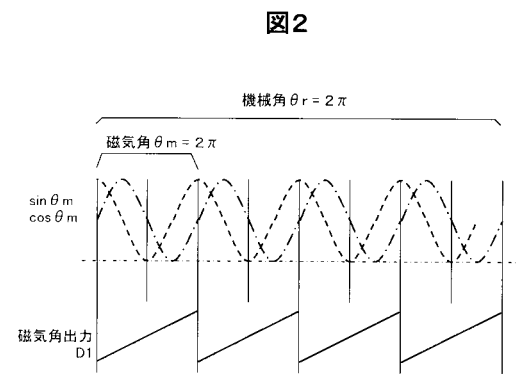
1 0 0 A ~ 1 0 0 F ...	ロータリーエンコーダー	10
1 1 0 ...	第 1 の磁石体	
1 1 1 s ...	小磁石	
1 1 1 p s ...	小磁石ペア	
1 1 2 ...	被覆部材	
1 2 0 ...	第 1 のヨーク部材	
1 3 0 ...	第 1 の 2 軸磁気センサー回路	
1 3 1 , 1 3 2 ...	増幅回路	
1 3 5 ...	信号処理回路	
1 4 0 ...	基板	
1 5 0 ...	支持部材	20
1 6 0 ...	磁気遮蔽部材	
2 1 0 ...	第 2 の磁石体	
2 2 0 ...	第 2 のヨーク部材	
2 3 0 ...	第 2 の 2 軸磁気センサー回路	
3 0 0 ...	位置信号生成部	
4 0 0 ...	回転体	
5 0 0 ...	電動モーター	
5 2 2 A , 5 2 2 B ...	電磁コイル	
5 3 0 ...	回転軸	
6 0 0 ...	制御部	30
6 1 0 ...	主制御回路	
6 2 0 A , 6 2 0 B ...	駆動信号生成部	
6 3 0 A 、 6 3 0 B ...	駆動回路	
7 1 0 ...	通信インターフェイス	
7 2 0 ...	データ受信部	
7 3 0 ...	位置信号生成部	
7 4 0 ...	角速度算出部	
7 5 0 ...	角加速度算出部	
7 6 0 ...	回転数算出部	
7 6 2 ...	アップダウンカウンタ	40
7 6 3 ...	ラッチ	
7 7 0 ...	回転数記憶部	
7 8 0 ...	入出力インターフェイス	
7 9 0 ...	レジスター	
7 9 5 ...	M P U	
8 0 0 ...	電池	
3 4 6 0 ...	関節モーター	
3 4 7 0 ...	把持部モーター	
3 4 8 0 ...	アーム	
3 4 9 0 ...	把持部	50

3 5 0 0 ... 鉄道車両
 3 5 1 0 ... 変速装置付モーター
 3 5 2 0 ... 車輪

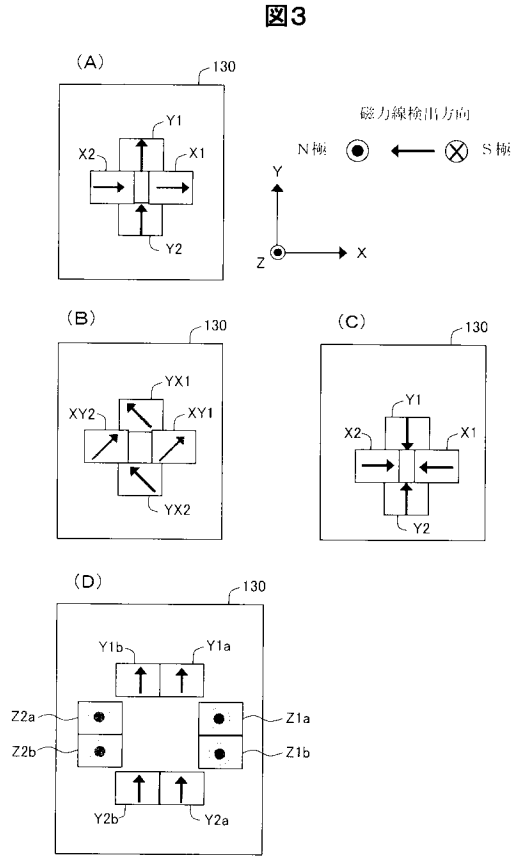
【図 1】



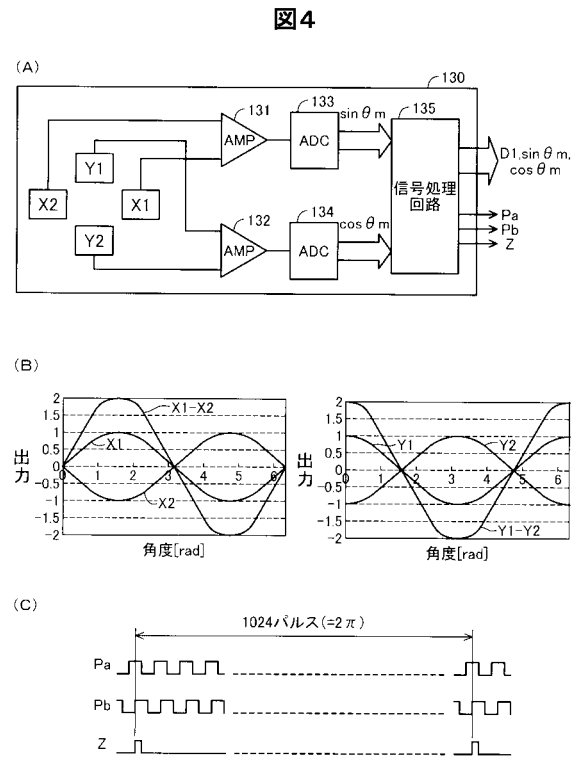
【図 2】



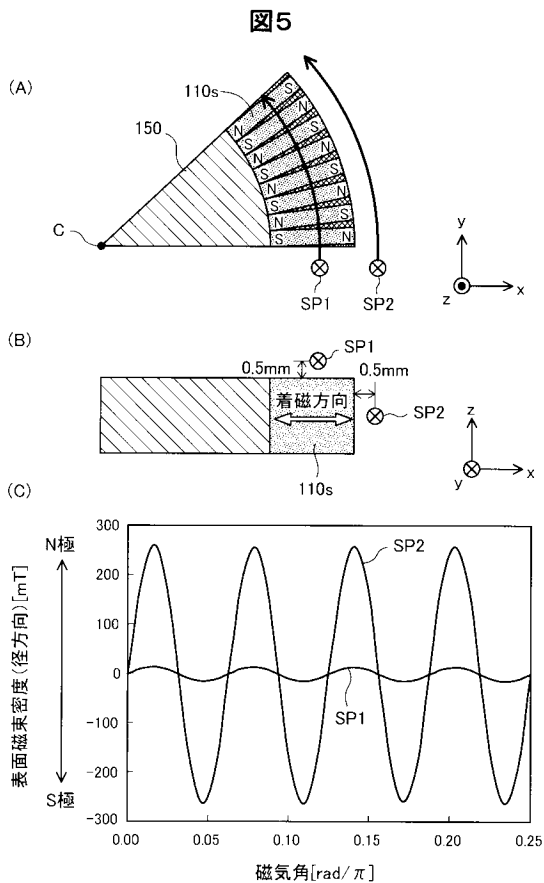
【図3】



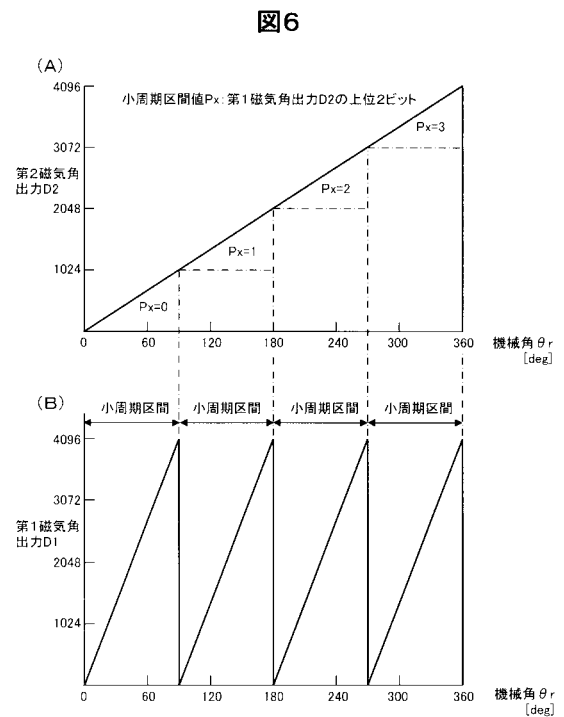
【図4】



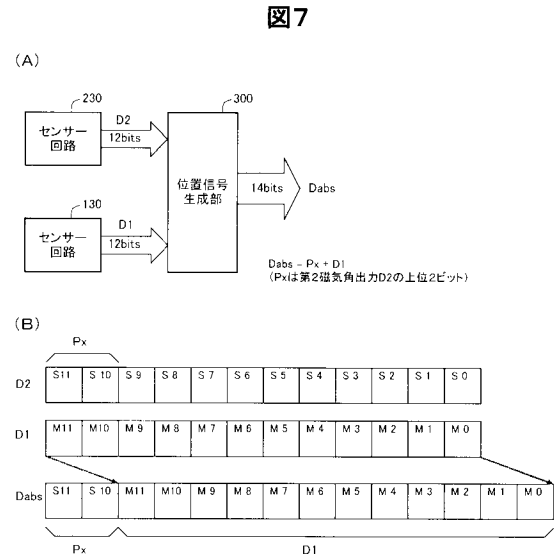
【図5】



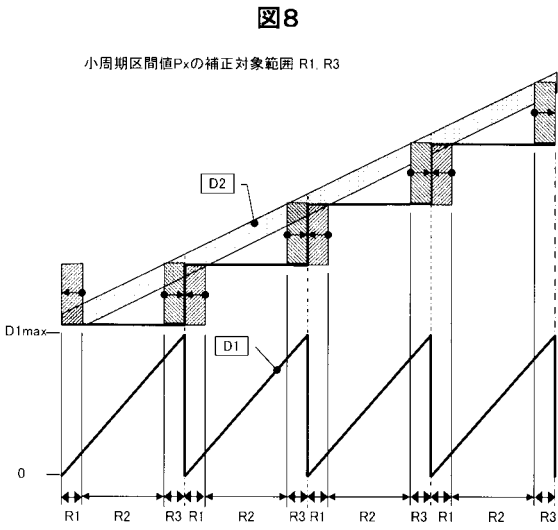
【図6】



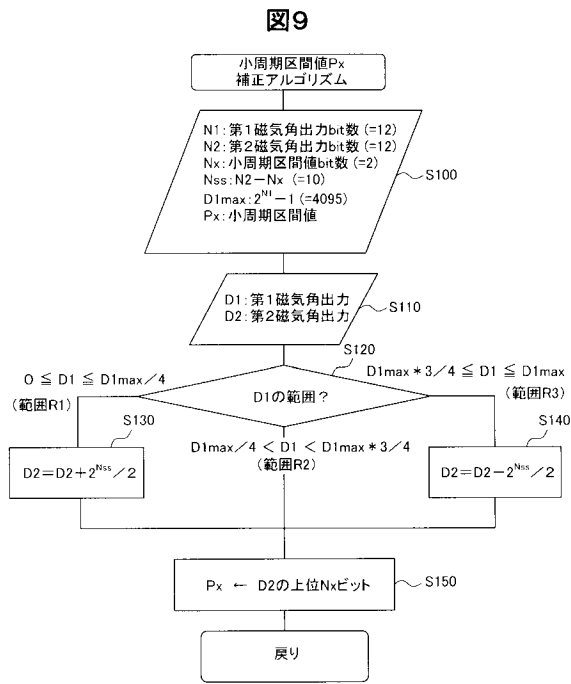
【 図 7 】



【 図 8 】



【 図 9 】



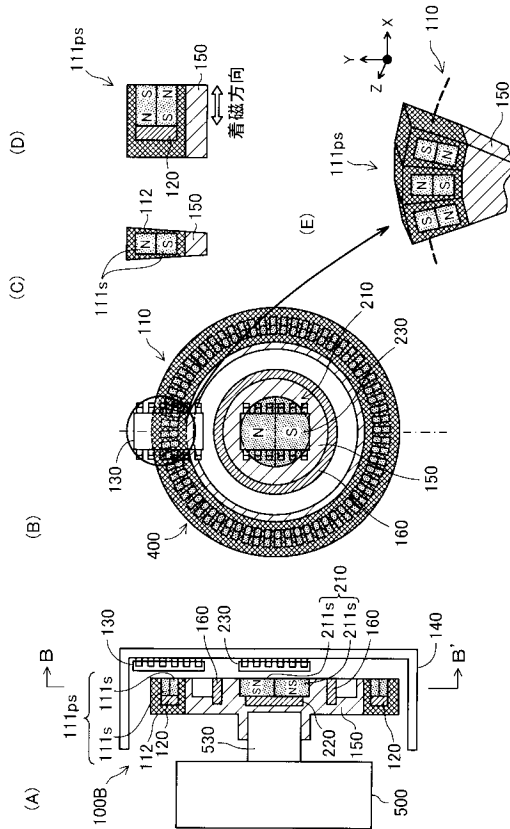
【 図 1 0 】

図10

第1の磁石体110		第2の磁石体210		1回転当たりの小周期区間		絶対位置出力Dabsのビット数 (=N1+Q)
極数M1	磁気角出力D1のビット数N1	極数M2	磁気角出力D2のビット数N2	発生個数	ビット数Q	
8	12	2	12	4	2	14
64	12	2	12	32	5	17
128	12	2	12	64	6	18
256	12	2	12	128	7	19
512	12	2	12	256	8	20

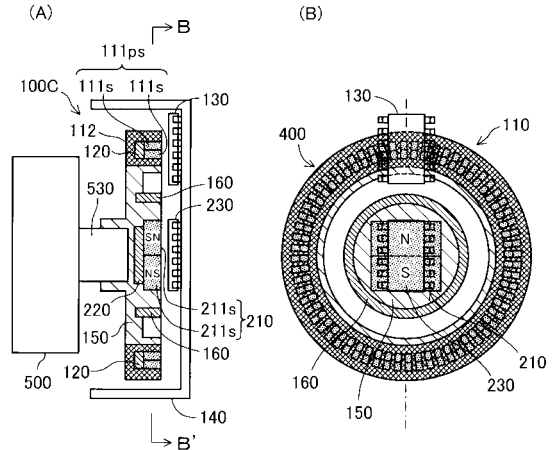
【図 1 1】

図 11



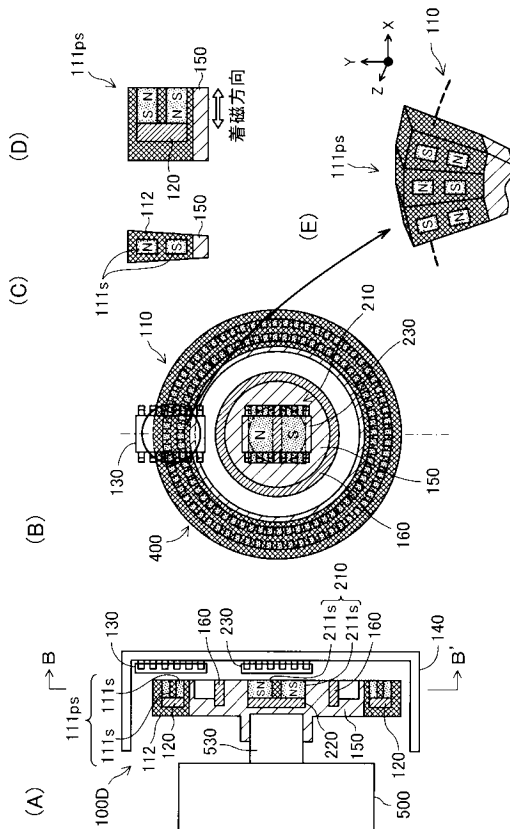
【図 1 2】

図 12



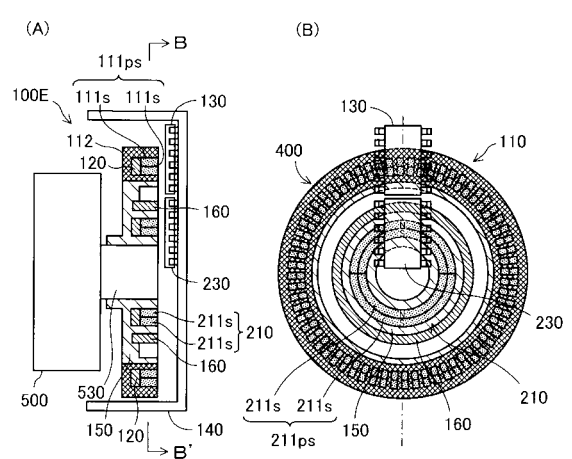
【図 1 3】

図 13

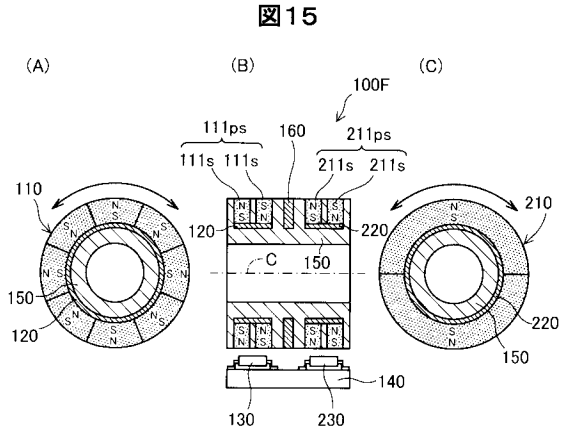


【図 1 4】

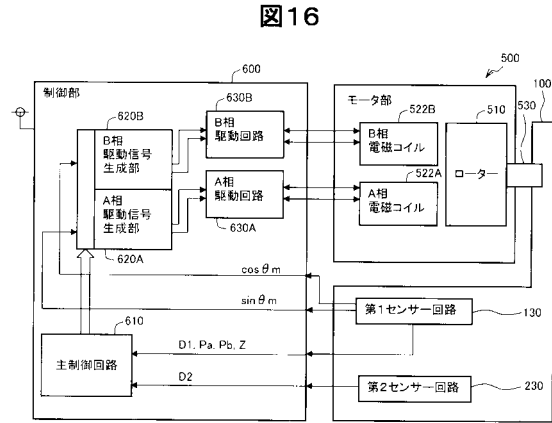
図 14



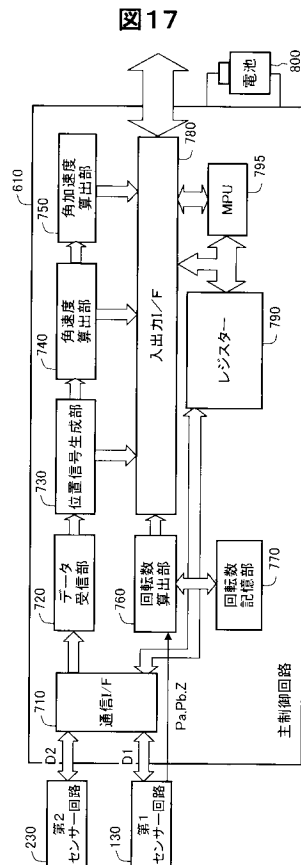
【 図 1 5 】



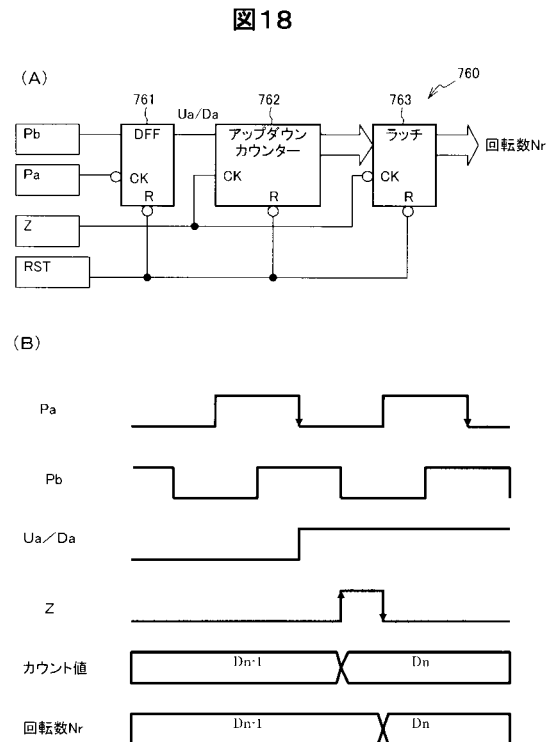
【 図 1 6 】



【 図 1 7 】

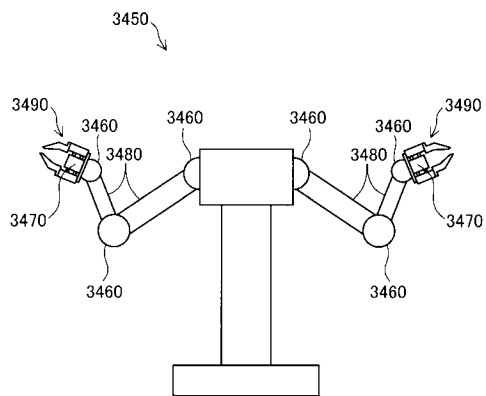


【 図 1 8 】



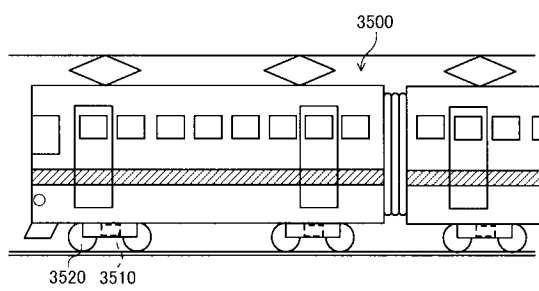
【図 19】

図19



【図 20】

図20



フロントページの続き

F ターム(参考) 2F077 AA25 AA27 CC02 CC07 CC08 NN04 NN08 NN10 NN17 NN24
PP12 QQ05 QQ10 QQ15 TT33 TT42 TT52 TT66 TT73 UU26
VV02 VV11
5H560 AA07 AA08 BB03 DA08 DB07